

POLOS® SPIN200x 旋涂仪

新的POLOS® SPIN200x提供了精确且可重复的过程控制。它由天然聚丙烯 (NPP) 制成，或者可选化学耐受的PTFE材质。这款经过充分验证的模型的新版本有标准版和高级版可供选择。它非常适合处理直径高达200毫米的各种基板或尺寸为150×150毫米的方形样品。



独特的设计

独特的外壳和排水设计使得设备能够在台式和嵌入式型号之间轻松切换。模块化设计使用户能够通过使用各种不同的配件来升级设备，从而简化分配和整体操作过程。

电机归位

新的SPIN x系列具有定义电机归零位置的能力，这使得其能够轻松集成到机器人控制或自动化环境中。

腔室易于访问

真空卡盘位于碗的边缘上方，使机械臂、镊子或真空棒能够轻松接触到晶圆/基板。这是实现机器人操作的一个独特要求。

硬件规格:

- 液体过滤器
- 盖子可自动开合，高级版本还可通过脚踏板控制
- 能够设定电机的归零位置
- 中心注射架用于安装注射器或分配喷嘴
- 设有盖锁和真空传感器，保障用户安全
- 配备大尺寸可拆卸触摸屏显示器。
- 设有USB端口，可用于在USB驱动器上存储配方以及进行软件更新
- 间接无刷驱动单元-最高转速可达12,000 RPM
- 高加速度和精度: 1 - 30,000 RPM
- 支持顺时针/逆时针旋转以及puddle模式
- 可在台式和嵌入式之间切换的独特设计

自动盖

盖子可以通过用户界面或脚踏板自动打开和关闭（适用于手套箱）。此外，还可以在配方的最后一步自动打开盖子。

液体过滤器

SPINx 系列配备了液体过滤阱，以保护旋涂机的关键部件。它将捕获通过工艺室或真空吸盘进入真空管路的任何液体或残留物，并将其装入液体容器中。可以通过旋杯外壳上的开孔看到容器，便于维护

配置	
腔室材质	天然聚丙烯(NPP) 或者 PTFE(可选择)
最大基板直径	最大 6 英寸 (150 毫米) 晶圆 最大 4 英寸 x 4 英寸 (100 毫米) 基板

适用于:

- 涂层
- 清洁
- 冲洗/干燥
- 显影
- 蚀刻
- PDMI 和其他工艺

标准配件:

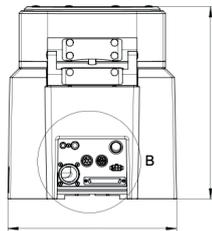
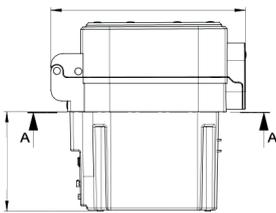
- 用于 4 - 8 英寸晶片的真空吸盘

标准版本 VS. 高级版本

MODEL	SPIN200x 标准版本	SPIN200x 高级版本
液体过滤器	Yes	Yes
独特的外壳和排水口设计	Yes	Yes
可编程电机归零位置	Yes	Yes
中心注射架用于安装注射器或分配喷嘴	Yes	Yes
盖锁和真空传感器，保障用户安全	Yes	Yes
大尺寸可拆卸触摸屏显示器.	Yes	Yes
USB端口，可用于在USB驱动器上存储配方	Yes	Yes
分配容器	No	Yes (可选的)
自动关闭盖子	No	Yes (可选的)
线性分配臂	No	Yes (可选的)
背面冲洗	No	Yes (可选的)
提供化学耐受的PTFE材质	No	Yes (可选的)

SPIN200x 尺寸

独特的外壳和排水设计使得设备能够在台式和嵌入式型号之间轻松切换



台式



嵌入式

可选配件



注射器架启动套件



透明0.5毫米PET衬垫



定位工具



中心分配系统：
opus



波纹排水管



POLOS® 真空泵



POLOS® 蠕动泵



中央分配注射器架